2016 年 3 月 30 日

各　　位

レーザーテック株式会社
東証第一部・コード 6920
代表取締役社長　岡林　理

新製品　大型マスクブランクス欠陥検査装置 LBIS（エルビス）を発表

この度レーザーテック株式会社は、大型マスクブランクス欠陥検査装置 LBIS（エルビス）を発表いたします。LBIS は、FPD 生産用途に使用される大型マスクブランクスの高感度かつ高スループットな欠陥検査とレビューが可能です。

近年の FPD 業界では、スマートフォンに代表される高精細ディスプレイや、4K・8K 高解像度テレビへの対応が急務となっており、大型フォトマスクのパターンの微細化が急速に進展しています。
それに伴い、フォトマスク製造に必要な大型マスクブランクスの品質管理が従来の目視検査では限界に達し、高感度な自動欠陥検査及び欠陥種・サイズ分類まで行う品質管理の必要性が高まっています。

レーザーテックでは、こうしたマスクブランクスでの高感度検査ニーズに対応すべく、2008 年に発表した LB79 の後継機種として、新製品 LBIS シリーズを製品化致しました。光学系の刷新により、高感度化・高スループット化を実現し、さらに自動欠陥レビューと自動欠陥分類機能を標準機能としました。
LBIS の適用によって、マスクブランクスの品質向上および、マスクの歩留り改善に貢献します。

【特　長】

- ハイパワーレーザー散乱光学系の採用により、高感度化・高スループット化を実現します。
- 反射微分干渉／透過光学系による高倍率欠陥レビューが可能です。
- 新開発のソフトウェアにより自動欠陥レビューを行ない、欠陥種・サイズの同時分類処理が可能です。
- G8／G10 サイズまで対応可能です。
- 各種アシストアームへの対応が可能です。

【用　途】

- Qz サブストレートの出荷・受入検査・レビュー（洗浄後・研磨後）
- クロムまたは酸化クロム成膜後の欠陥検査・レビュー
- レジストコート後の欠陥検査・レビュー

【仕様】

項目	仕様
検出感度	0.3μm （Qz 上 PSL）
検査時間	20min （G8 サイズ）
レビュー方式	反射微分干渉／透過（同時レビュー）

【受注・販売目標台数】

初年度　4 台

◇製品お問い合わせ先◇
〒222-8552　横浜市港北区新横浜 2-10-1
レーザーテック株式会社　　第 1 ソリューションセールス部　リーダー　神山　弦一郎
TEL：045-478-7337　**FAX**：045-478-7333　**E-mail**：　sales@Lasertec.co.jp

以上